

日本表面科学会 第81回表面科学研究会
日本真空学会 2014年2月研究例会

主題「放射光 X 線・中性子線技術を利用した溶液に埋もれた界面構造解析」

超高真空下と異なりこれまで溶液に埋もれた界面では、溶液層（主として水）の存在によりその場構造解析は困難とされてきました。放射光を利用した X 線・中性子線技術は、その困難さを克服し界面の詳細な三次元構造を知る数少ない手法のうちの 1 つですが、その利用は限られており、特に国内で本手法を用いているグループは少ないのが現状です。そこで、X 線・中性子線技術の有用性を広く示し、X 線・中性子線技術による埋もれた界面のその場構造解析の利点・問題点を議論していただき、この分野のさらなる発展に寄与する事を目的とし、本研究会を企画いたしました。本研究会では、この分野を先導している 6 名の講師の方々をお招きし、放射光を利用した X 線・中性子線技術の埋もれた界面への適用例を紹介していただき、最先端の研究結果を含めて講演していただきます。多くの方々のご参加をお待ちしております。

日 時：2014年2月5日（水）10：20～16：00（受付9：50～）

会 場：東京理科大学森戸記念館 第1会議室

東京都新宿区神楽坂 4-2-2

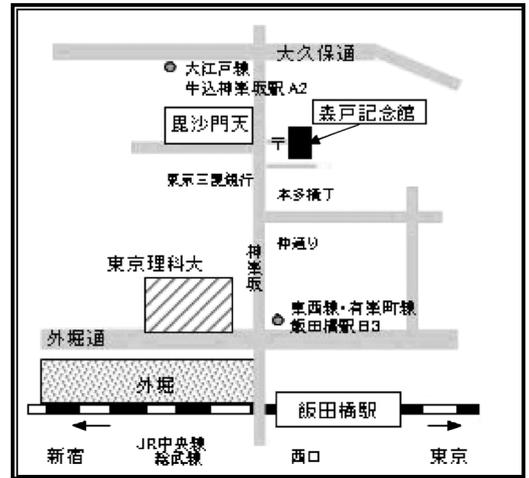
<http://www.tus.ac.jp/info/access/kagcamp.html>

電話 03-5228-8110

JR 総武線、地下鉄有楽町線、東西線、南北線

飯田橋駅下車 徒歩 6 分

大江戸線 牛込神楽坂駅下車 徒歩 4 分



講演プログラム 〈各講演40分（質疑応答込）〉

開会の挨拶

10：20～10：25

1. X 線を利用した固液界面計測（仮題）

（お茶の水女子大）近藤敏啓 10：25～11：05

2. X 線回折法による固液界面の電気二重層構造とダイナミクス

（千葉大学）中村将志 11：05～11：45

（休憩）

3. 埋もれた界面の中性子解析（仮題）

（物質・材料研究機構）櫻井健次 13：00～13：40

4. 中性子反射率計 SOFIA を用いた固液界面測定

（高エネルギー加速器研究機構）山田悟史 13：40～14：20

（休憩）

5. 軟 X 線吸収分光法による電極固液界面の局所構造の解明

（分子科学研究所）長坂将成 14：35～15：15

6. X 線反射率測定によるイオン液体界面の構造解析

（京都大学）西 直哉 15：15～15：55

閉会の挨拶

15：55～16：00

参加費（当日会場にてお支払いください）

日本表面科学会会員、日本真空学会会員

2,500円（予稿集代を含む）

非会員

3,500円（予稿集代を含む）

学 生

無 料（予稿集500円）

申込方法

ウェブサイト（<http://www.sssj.org/>）または E-mail を使い、次の項目を記入してお申込ください。

・氏名（ふりがな）、・所属、・連絡用 E-mail アドレス、・参加区分（会員、学生、一般）

問い合わせ先

公益社団法人 日本表面科学会 TEL 03-3812-0266 FAX 03-3812-2897

E-mail: shomu@sss.jp URL <http://www.sss.jp/>

一般社団法人 日本真空学会 TEL 03-3431-4395 FAX 03-3433-5371

E-mail: ofc-vs.jp URL <http://www.vacuum.jp>

お申込に際しご記載いただきましたメールアドレスは、日本表面科学会、日本真空学会が主催する本件以外のセミナー・講演会などのご案内にも使用させていただく場合がございます。ご案内が不要な方はお手数ですがその旨お申し出ください。